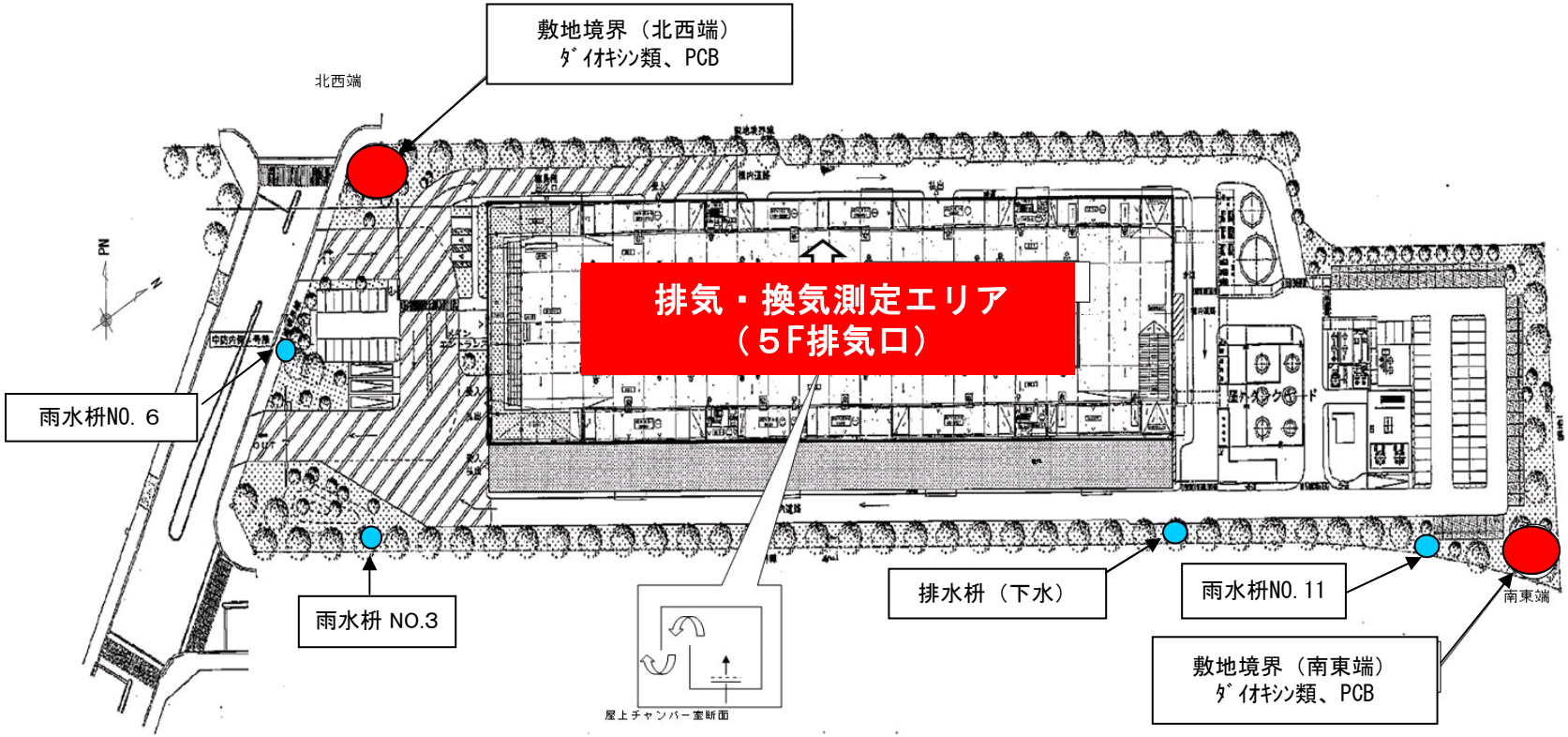
東京ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業

平成21年度　環境モニタリング調査結果

日本環境安全事業株式会社
東京事業所

区分	測定場所	測定項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	定量下限	管理目標値	頻度
水質（下水）	下水道排水枡	PCB	mg/ℓ	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		0.0005	0.0015 以下	月1回
		pH		8.1	8.4	8.1	8.3	8.1	8.2	8.0	8.2	8.0	8.1	8.1		－	5を超え9未満	月1回
		n-Hex	mg/ℓ	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		1	5　以下	月1回
		BOD	mg/ℓ	2.1	1.0	1.0	1.4	1.7	0.8	1.8	2.1	2.9	3.3	1		0.5	600　以下	月1回
		SS	mg/ℓ	3	2	3	5	3	4	5	2.0	9.0	3.0	1.0		1	600　以下	月1回
		Zn	mg/ℓ	2.2	1.40	0.48	0.58	0.92	0.70	0.59	0.78	0.83	0.42	0.68		－	2.0以下	月1回
		N	mg/ℓ	4.7	5.6	2.9	4.6	7.3	11	5.6	10	8.3	13	12		0.2	120　以下	月1回
		ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	－	－	－	－	1.1	－	－	－	－	－	0.75		－	5　以下	年2回
大気（排気・換気）	排気系統1（水熱分解・洗浄系）	PCB	mg/Nm³	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		0.0005	0.01 以下	月1回
		ダイオキシン類	pg-TEQ/Nm³	0.57	－	－	－	0.27	－	－	－	0.53	－	0.25		－	100 以下	年2回
		IPA	ppm	－	－	－	－	50	－	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		－	40 以下	年2回
	排気系統2（解体室系）	PCB	mg/Nm³	ND	ND	ND	0.00064	ND	0.00055	0.00069	0.00085	0.0015	0.00051	0.0015		0.0005	0.01 以下	月1回
		ダイオキシン類	pg-TEQ/Nm³	9.0	－	－	－	9.9	－	－	－	42	－	18		－	100 以下	年2回
	換気系統1（洗浄・加熱炉系）	PCB	mg/Nm³	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		0.0005	0.001 以下	月1回
		ダイオキシン類	pg-TEQ/Nm³	0.041	－	－	－	0.021	－	－	－	0.044	－	0.056		－	5 以下	年2回
	換気系統2（解体室系）	PCB	mg/Nm³	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		0.0005	0.001 以下	月1回
		ダイオキシン類	pg-TEQ/Nm³	0.099	－	－	－	0.39	－	－	－	0.11	－	0.67		－	5 以下	年2回
大気（敷地境界）	南東端	PCB	mg/Nm³	ND	－	－	－	ND	－	－	－	ND	－	ND		0.00005	0.0005 以下	年1回
	北西端			ND	－	－	－	ND	－	－	－	ND	－	ND				
	南東端	ダイオキシン類	pg-TEQ/Nm³	0.12	－	－	－	0.022	－	－	－	0.056	－	0.16		－	0.6 以下	年1回
	北西端			0.54	－	－	－	0.025	－	－	－	0.046		0.13				
水質（雨水）	排水枡NO.3	PCB	mg/ℓ	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－		0.0005	0.0015 以下	年1回
	排水枡NO.6			－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－				
	排水枡NO.11			－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－				
	排水枡NO.3	ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	－	－	－	－	0.20	－	－	－	－	－	－		－	5 以下	年1回
	排水枡NO.6			－	－	－	－	0.84	－	－	－	－	－	－				
	排水枡NO.11			－	－	－	－	2.4	－	－	－	－	－	－				
大気（低濃度排気）	分解系統	PCB	mg/Nm³	－	－	ND	－	ND	－	－	－	4E-05	－	ND		0.00003	0.0001 以下	年4回
	抜油系統			－	－	ND	－	ND	－	－	－	ND	－	ND				

（注） NDは定量下限未満を示す。測定項目及び頻度は環境保全協定書及び関係法令等に基く。

東京ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業
環境モニタリング調査地点

（別紙）